CLIPPEDIMAGE= JP406180869A

PAT-NO: JP406180869A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06180869 A

TITLE: FORMING METHOD OF ORGANIC PROTECTIVE FILM

PUBN-DATE: June 28, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KONISHI, HIROSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NIKON CORP

N/A

APPL-NO: JP04334444

APPL-DATE: December 15, 1992

INT-CL (IPC): G11B007/26

US-CL-CURRENT: 369/283

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent infiltration and deposition of a resin on the back surface of a substrate by forming an org. protective layer on the disk while rotating the substrate with a tray having a specified outer diameter.

CONSTITUTION: A resin 6 is applied on the surface of a substrate having a recording layer 4 by spin coating method using centrifugal force while the substrate 1 is rotated with a spinner head of a tray 8. The outer diameter of this tray 8 is at least same or larger than that of the substrate 1. A small space is formed between the back surface of the substrate 1 and the tray 8. Thereby, the org. protective films formed on the substrate while deposition of the resin 6 on the back surface of the substrate 1 due to infiltration of the resin or resin mist 7 is prevented. The obtd. optical disk has good qualities with higher rotation characteristics.

DERWENT-ACC-NO: 1994-246143

DERWENT-WEEK: 199430

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Forming organic protective film on disc baseboard for mfg. optical discs - comprises laying baseboard on support dish and forming protective film during baseboard rotation

PATENT-ASSIGNEE: NIKON CORP[NIKR]

PRIORITY-DATA: 1992JP-0334444 (December 15, 1992)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE **PAGES** MAIN-IPC

JP 06180869 A June 28, 1994 N/A 003 G11B 007/26

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE JP06180869A N/A

1992JP-0334444 December 15, 1992

INT-CL (IPC): G11B007/26

ABSTRACTED-PUB-NO: JP06180869A

BASIC-ABSTRACT: Process comprises laying disc baseboard on a baseboard support dish having an outer dia. not less than that of the baseboard and forming a protective film during rotating of the baseboard.

USE - Used for making optical discs.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/3

TITLE-TERMS:

FORMING ORGANIC PROTECT FILM DISC BASEBOARD MANUFACTURE OPTICAL DISC COMPRISE

LAY BASEBOARD SUPPORT DISH FORMING PROTECT FILM BASEBOARD **ROTATING**

DERWENT-CLASS: G06 L03 T03 W04

CPI-CODES: G06-A08; G06-D07; L03-G04B;

(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-180869

(43)公開日 平成6年(1994)6月28日

(51)Int.Cl.5

識別記号

厅内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G11B 7/26

531

7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数3(全 3 頁)

(21)出願番号

特願平4-334444

(22)出願日

平成 4 年(1992)12月15日

(71)出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72) 発明者 小西 浩

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

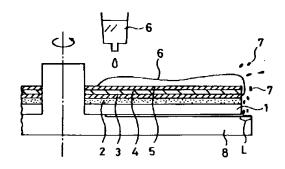
式会社ニコン内

(74)代理人 弁理士 長瀬 成城 (外1名)

(54) 【発明の名称 】 有機保護膜の形成方法

(57)【要約】

【目的】 基板裏面への樹脂の回り込み、ミスト状樹脂 の付着等のない、品質の良好な光ディスクを製造する。 【構成】 記録層4を有するディスク基板1上に基板1 を回転させながら有機保護膜を形成させる際に、基板1 の外径と同一またはそれ以上の外径を有する基板支持用 の受け皿8を配置する。



20

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 記録層を有するディスク基板上に基板を 回転させながら有機保護膜を形成させる方法において、 基板の外径と同一またはそれ以上の外径を有する基板支 持用の受け皿を配置してディスク基板上に有機保護膜を 形成させることを特徴とする有機保護膜の形成方法。

【請求項2】 基板の外径と同一またはそれ以上の外径 を有してなる、ディスク基板上への有機保護膜の形成に 用いられる基板支持用の受け皿。

【請求項3】 請求項1の方法により形成される有機保 10

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、有機保護膜の形成方 法に関するものである。さらに詳しくは、この発明は、 光ディスクに有用な有機保護膜を形成させる方法に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】情報記録媒体として優れた特性が注目さ れている光ディスクについては、その記録材料として、 たとえば光磁気方式の場合にはTbFeCo(テルビウ ム鉄コバルト)、GdTbFe(ガドリニウムテルビウ ム鉄)等の希土類-遷移金属合金薄膜が用いられてい る。これらの記録膜は酸化、腐食などしやすいため、一 般に、無機保護層で記録層を被覆し、保護している。し かしながら、この無機保護層はきわめて薄いために保護 層としての強度が小さいという問題が指摘されており、 従来では、さらに樹脂よりなる有機保護膜層を設けても いる。この有機保護膜層を形成させる方法としては、回 転しているディスク基板上に樹脂液を滴下し、螺旋状ま 30 たは同心円状に塗布した後に、樹脂液に遠心力を与えて 外周縁まで拡げる、いわゆるスピンコート法 (特開昭6 3-42052号等) や、回転している基板上に樹脂液 をスプレー塗布し、保護膜層を形成させるスプレー法 (特開昭63…96753号) がこれまでに知られてい

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 有機保護膜の形成方法においては、樹脂液をスピンコー トあるいはスプレー塗布する際に、樹脂液が基板の裏面 40 へ回り込んだり、ミスト状の樹脂液が基板の裏面に付着 してしまうという問題があった。樹脂液の回り込みによ るだれは、たとえば基板の回転数等を調節することによ ってある程度軽減させることは可能であるが、ミスト状 樹脂液の基板裏面への付着は避けることはできない。

【0004】たとえば図2は従来のスピンコート法を示 したものであるが、ディスク基板(ア)には溝材層 (イ)、無機保護層(ウ)、記録層(エ)、無機保護層 (オ)が順次積層されている。これらの各層は、その外 径をすべて等しくしている。ディスク基板(ア)は、ス 50 の余分な樹脂層およびミスト状樹脂液の付着を防止する

ピンナーヘッド(キ)により中心孔を中心に回転し、硬 化乾燥後に有機保護膜を形成する樹脂液(カ)がディス ク基板(ア)上にコーティングされる。

【0005】しかしながら、その有機保護層の均質化の ために、樹脂液(カ)を基板(ア)の中高速回転により 外周縁まで拡げると、余分な樹脂層やミスト状樹脂

(ク)が基板(ア)裏面へ付着してしまう。また、図3 に例示したスプレーコート法においては、上記と同様の 構造を有するディスク基板 (ア) がスピンナーヘッド (キ)により中心孔を中心に回転し、硬化乾燥後に保護 層を形成する樹脂液(カ)は、圧力ガスの作用を受けて 上方から均一にスプレーされる。しかしながら、この方 法においては、樹脂液(カ)が基板(ア)の裏面にもス プレーされることとなり、余分な樹脂層、ミスト状樹脂 (ク)の付着等が発生する。

【0006】このように、いずれの方法の場合にも、基 板裏面、すなわちディスク読み出し面に樹脂液による被 覆膜の形成や、ミスト状樹脂の付着などが発生してしま う。その結果、余分な付着樹脂部でレーザービームのデ フォーカス(所定の目標位置で焦点が合わない)が起こ り、このデフォーカスによりフォーカシングエラー、ト ラッキングエラー、シーク (ピームスポットとディスク 上の所定番地を合致させる動作)エラー等が発生しやす かった。

【0007】また、ディスク基板裏面に形成した余分な 被覆膜は、外部からの影響を受けやすい場所に位置する ため、後工程ではがれてゴミを生じやすい。発生するゴ ミは、上記のエラーを助長する一因となってもいた。こ の発明は、以上の通りの事情に鑑みてなされたものであ り、従来のディスク基板上への有機保護膜の形成方法の 欠点を解消し、基板裏面への樹脂の回り込み、ミスト状 樹脂の付着等のない光ディスクを製造することのでき る、改善された有機保護膜の形成方法を提供することを 目的としている。

[8000]

【課題を解決するための手段】この発明は、上記の課題 を解決するものとして、記録層を有するディスク基板上 に基板を回転させながら有機保護膜を形成させる方法に おいて、基板の外径と同一またはそれ以上の外径を有す る基板支持用の受け皿を配置してディスク基板上に有機 保護膜を形成させることを特徴とする有機保護膜の形成 方法を提供する。

[0009]

【作 用】この発明の有機保護膜の形成方法において は、基板の外径と同一またはそれ以上の外径を有する基 板支持用の受け皿(スピンナーヘッド)を用いることに よって、スピンナーヘッドにより基板裏面側を保護する ことができる。スピンコート法の場合には、遠心力によ り樹脂液を基板外周縁まで塗り拡げる時に、基板裏面へ

ことができる。一方、スプレー法の場合には、ミスト状 樹脂液塗布時に樹脂液の基板裏面への回り込みを防止す ることができる。

[0010]

【実施例】以下実施例を示し、この発明の有機保護膜の 形成方法についてさらに詳しく説明する。 図1に例示し たように、ディスク基板(1)としての外径304.8 両, 厚さ1.2mm の円形ガラス板上に、トラッキンググルーブ 用のフォトポリマーの溝材(2P)(2)を形成させ た。次いで、基板(1)上に無機保護層としてSiN膜 10 一、シークエラー等の発生を防止することができる。 (3) を700 Å, 記録層としてTbFeCo膜(4)を 500 A. さらに無機保護層としてのSiN膜(5)を70 0 Åにスパッタリング法により形成させた。この後に、 ディスク基板 (1) の外径よりL (=5.2mm) だけ大き い、外径310㎜ のスピンナーヘッド(8)上に上記の基 板(1)を乗せ、柴外線硬化型樹脂(6)をスピンコー ト法により塗布し、約8µmの膜厚の有機保護層を形成 させた。この時の振り切りの回転数は800rpmとした。そ して、紫外線を照射し、樹脂(6)を硬化させて光ディ スクを作製した。

【0011】硬化後に光ディスクを取り出し目視検査を したところ、裏面への樹脂層およびミスト状樹脂(7) の付着は全くなかった。また、作製した光ディスクを10 00hの連続記録・再生試験にかけたところ、読み出し面 への樹脂付着に起因するフォーカシングエラー、トラッ キングエラー、シークエラーは発生しなかった。もちろ

んこの発明は、以上の例によって限定されるものではな い。基板の種類および大きさ、記録層、保護層および樹 脂の種類や膜厚等の細部については様々な態様が可能で あることはいうまでもない。

4

[0012]

【発明の効果】以上詳しく説明した通り、この発明によ って、基板裏面への樹脂の回り込みやミスト状樹脂の付 着などのない、品質の良好な光ディスクを製造すること ができる。フォーカシングエラー、トラッキングエラ

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の有機保護膜の形成方法を例示した断 面図である。

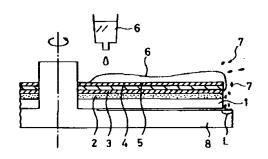
【図2】従来のスピンコート法を例示した断面図であ る。

【図3】 従来のスプレーコート法を例示した斜視図であ る。

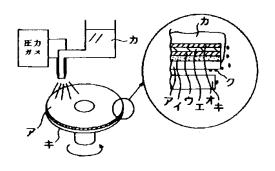
【符号の説明】

- 1 ディスク基板
- 20 2 溝材層
 - 無機保護層 3
 - 4 記録層
 - 5 無機保護層
 - 樹脂 6
 - 7 ミスト状樹脂
 - スピンナーヘッド

【図1】



【図3】



【図2】

